



**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 ROKU**

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _____

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w następujący sposób:

- 1) w § 6 Statutu Spółki dodać nowe pkt 40 i 41 o następującym brzmieniu:

„40. PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego.

41. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.”

- 2) zmienić dotychczasową treść § 14 ust 7 Statutu Spółki:

„§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.”

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

- 3) zmienić dotychczasową treść § 16 Statutu Spółki:

„§ 16. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

nadając mu następujące brzmienie:



„§ 16.1. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. W przypadku śmierci lub rezygnacji jednego z członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład i jednomyślną uchwałą wszystkich pozostałych członków dokooptować jednego nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Plasma SYSTEM S.A. VIII kadencji będzie się składać z 6 członków i dokonuje w tym zakresie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej, VIII kadencji Pana/Panią

_____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*